

第299回触媒化学研究センタークロキウム

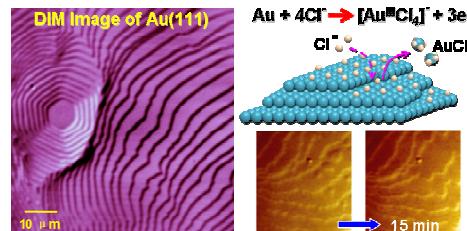
Evaluation of Electrode Processes with Atomic Scale: From Nano-scale to Macro-scale

板谷謹悟 (東北大学原子分子材料科学高等研究機構)

2011年8月19日(金)15:00–16:30
(創成科学研究棟4階セミナー室B・C)
<http://www.cat.hokudai.ac.jp/access.html>



We have recently found that a laser scanning confocal microscope combined with a differential interference contrast microscope (LCM-DIM) can observe the single atomic step of Au(111) [1]. It is also demonstrated that single atomic steps with step heights of 0.31 nm and 0.12 nm can be clearly seen on Si(111) and Si(001) in a NH₄F solution using LCM-DIM, respectively. In the present talk, atomic processes of metal electroplating and crystallization of organic semiconductor materials at solid/liquid interface revealed by LCM-DIM will be discussed.



[1] R. Wen, A. Lahiri, M. Azhagurajan, S. Kobayashi, and K. Itaya, JACS, 2010, 132, 13657.

問合せ先：触媒化学研究センター・大澤雅俊 (osawam@cat.hokudai.ac.jp・011-706-9123)

略歴：1948年北海道生まれ・東北大学工学部応用化学科卒業・1977年同大学院博士課程修了、工学博士・1977–1979年テキサス大学博士研究員(Bard研)・1979年東北大学工学部助手・1984年同助教授・1991年同教授・1992–1997年ERATO総括責任者・2002–2007年CREST研究代表 電気化学STMの開発と電極表面科学の開拓で顕著な業績を挙げ、日本化学会進歩賞、日本化学会学術賞、日本化学会賞、仁科賞、紫綬褒章、加藤記念賞などを受賞。

